# WEST

L2: Entry 2 of 17

File: JPAB

Jan 29, 1999

PUB-NO: JP411025772A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11025772 A

TITLE: OXIDE SUPERCONDUCTING TAPE AND MANUFACTURE THEREOF

PUBN-DATE: January 29, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NAKAJIMA, JUNKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NAKAJIMA JUNKO

APPL-NO: JP10072463

APPL-DATE: March 20, 1998

INT-CL (IPC): H01B 12/06; H01B 13/00

#### ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a superconducting substance of low bending strength with required flexibility by forming a tape-like <u>silver</u> film on a film object of perovskite oxide so as to form plural units of laminate as unit structure, and sticking substance capable of exhibiting a lubricating effect onto the interface between the laminates.

SOLUTION: Silver foils 20, 21 are sintered at upper and lower surfaces of a single oxide super conducting film 10, thereby forming a laminate 40. Thermoplastic insulating films 30, 31 are fused at upper and lower surfaces of the laminate 40, to be rolled and enlarged in width. Portions 30B, 31B pushed at both side ends of a tape are bent inward to be fused to each other, thereby forming a cylindrical insulating structure. Even if a clearance 32 is formed between the laminate 40 and the side end insulating films 30B, 31B, no faulty from the practical viewpoint is generated. Surface the oxidation of the silver foil is performed by anode oxidation method in a first process, so that the oxygen shortage of the superconductor oxide can be compensated in a preceding heating process. In a second process, the silver foil via the first process is fused onto a cellulose triacetate base film applied with polystyrene, thus compensating for the mechanical strength.

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-25772

(43)公開日 平成11年(1999)1月29日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>
---------------------------

識別記号

FΙ

H01B 12/06

ZAA

H 0 1 B 12/06 13/00

ZAA 565D

13/00

565

# 審査請求 有 請求項の数1 OL (全 12 頁)

(21)出願番号

特願平10-72463

(62)分割の表示

特顧昭63-311958の分割

(22)出願日

昭和63年(1988)12月12日

(31) 優先権主張番号 特顧昭62-318406

(32)優先日

昭62(1987)12月15日

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 398012214

中嶋 純子

東京都小金井市本町1-2-15

(72)発明者 中嶋 純子

東京都小金井市本町1-2-15

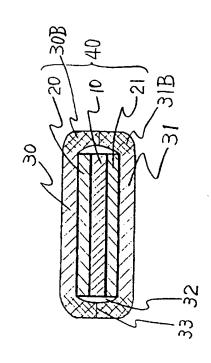
(74)代理人 弁理士 大塚 康徳 (外2名)

## (54) 【発明の名称】 酸化物超伝導テープ及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 曲げ強度の弱い超伝導物質に必要な可撓性を 与える酸化物超伝導テープを提供する。

【解決手段】 本発明の酸化物超伝導テープでは、鱗状 のペロブスカイト型酸化物超伝導片がテープ面とほぼ平 行に配列され緻密に焼結されている。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 鱗状のペロブスカイト型酸化物超伝導片 がテープ面とほぼ平行に配列され緻密に焼結されている ことを特徴とする酸化物超伝導テープ。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はテープ状超伝導電線 に係り、特に電磁石用巻線材として使い易く可撓性の高 い長尺絶縁被覆電線に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の金属系超伝導電線(超電導線とも 記す)は金属細線を多数本束ねて太い金属母線内に埋め 込む構造であるため可撓性不足を感ずることは少なかっ た。また、テープ構造の場合は厚い中心材の両側に超伝 導合金を形成していた。

【0003】これに対し1986年より1987年にか けてベドノルツ(J.G.Bedonorz), ミュラー(K.A.Muller) 両氏などによって発見された酸化物は、BCS理論によ り期待された格子結合により実現できる超伝導性の高温 限界よりも高い温度(例えば90K)において超伝導性 20 を示すが、一方、現在までに確認されたこの種物質は、 いずれも機械的強度が弱く、特に引張り強さ及び曲げ強 さが弱く、この種の新超伝導物質を用いて巻線用電線を 形成することが困難であった。

【0004】このような従来技術に関する説明は、

(株)工業調査会発行の書籍「・新産業革命への起爆材 超伝導セラミックス」(1987年8月5日,長谷川 安利・岡村富士夫・小野晃 共著), (株)東京化学同 人発行の雑誌「現代科学」(昭和62年11月1日, 通 巻200号),(株)日刊工業新聞社発行の雑誌「トリ ガー」(昭和63年1月1日発行, 第7巻, 第1号)な ど各種の出版物に詳細に記述されている。

【0005】これら出版物によれば、現時点で予想され る実用性の高い物質は、YBa2Cu3O7など銅(C u)を主材、バリウム(Ba)あるいはストロンチウム (Sr)とイットリウム (Y) あるいはランタン系元素 (Ln、但し4価元素を除く)を副材とする複合酸化物 であり、その結晶構造は3層ペロブスカイト形式であっ て層面へき開性を有し、電気的には層面を良導面とする ないし5層のペロブスカイト形式を持つ、BiSrCa Cu系, TiSrCaCu系など、より高い温度におい て超伝導性を示す複合酸化物も発見されている。その構 造は、多くの場合、鱗状あるいは針状の微結晶であっ て、結晶学的には、層面をc面あるいはa-b面と呼 び、層面に垂直な方向をc軸と呼んでいる。また、ab面内の2軸をa軸、b軸と呼ぶ。

【0006】「・新産業革命への起爆剤 超伝導セラミ ックス」第41頁から第43頁によれば、この種物質の

てa-b面より構成されているように読み取ることがで き、また昭和62年12月の東京大学物性研究所公開展 示の写真からも判読可能である。また第35頁から第3 7頁によれば、この種物質の酸素含有量が温度などによ り変化し、第47頁から第52頁によれば酸素含有量に より超伝導特性が変化している。さらに前記「現代化 学」誌の第46頁から第50頁によれば銀(Ag)管内 にこの種複合酸化物を充填して超伝導線を作る方法が示 されており、管材としては銀が最適であると記されい 10 る。このほか、このような銀管充填構造物を圧延平坦化 してテープ状とした例もある。

【0007】一方、前記「トリガー」誌の第20頁によ ればY2O3, BaCO3とCuOの混合物を初期原料と して作成した超伝導物質の粉を有機バインダと混練した 後にコイル状に巻線形成し、これに加熱処理を施して超 伝導コイルとした例が記されており、この種複合酸化物 を用いて巻線することの難しさを示しているといえる。 また同じ頁に、このコイル作成原料として「酸素を吸収 しやすい特別の粉末」と記されており、詳細は不明なが らも重要な技術と思われる。

【0008】次に超伝導線共通の問題としてフラックス ジャンプ現象がある。この現象は磁気的変動に伴う発熱 高温化と超伝導性の局部的喪失である。複合酸化物、特 にYBa2Cu3O7に関してはフラックスジャンプなど による酸素放出が予想されるが、この種問題の解決法は 本発明者の知るかぎりでは今までに明示的には発表され ていない。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】この発明の第1目的 は、曲げ強度の弱い超伝導物質に必要な可撓性を与える ために、形状・寸法効果を利用することであり、第2目 的は曲げ破壊による亀裂の発生またはフラックスジャン プによる超伝導性喪失に備えて導電側路を用意すること であり、第3目的はフラックスジャンプに伴う発熱高温 化により酸化物超伝導物質が放出する酸素を放出点近く の場所に蓄積しておき、冷却時に一部分ではあっても酸 素放出個所に復帰させ、これによって超伝導特性の劣化 を軽減することであり、第4目的は上記の3目的を達成 するために薄膜化した超伝導線の絶縁被覆を形成する簡 2次元導体と考えられている。なお、このほかにも3層 40 単な方法を提供することであり、第5目的は薄膜化した 超伝導線即ち超伝導テープを量産する為の簡単な方法を 提供することである。

## [0010]

【課題を解決するための手段】上記の第1ないし第3目 的を達するための具体的手段として、超伝導性酸化物を 主成分とする膜状物体の面上に銀膜を積層形成して、テ ープ状となし、この積層体を単位構造として必要に応じ て複数単位を積層し、各単位積層体間の面に、曲げ加工 温度において潤滑作用を呈する物質を付着させた構造を 典型である $YBa_2Cu_3O_7$ 材の焼結体破断面は主とし 50 考えた。第4目的を達するための手段としては、テープ

状超伝導体の両面あるいは片面に圧着または堆積形成された熱可塑性絶縁膜を可塑状態に於て圧延拡幅または流動拡幅し、あるいは拡幅後に側端を曲げて筒状とするなど、側端絶縁性を付与する方法を考えた。第5目的を達するための手段としては(1)破砕・溶解・揮発・燃焼分解などにより分解除去あるいは剥離できるベースフィルム上に銀膜を形成し、必要に応じて銀膜表面を酸化した後に該表面上に超伝導性酸化物の膜を形成し、次いで適当な加工段階にてベースフィルムを除去する方法、

(2) 細長い平面形状を有する膜状物体に、長手方向に 10整列して一定の間隔を保って穴を開け、長手方向に移動する歯に係合させて前記膜状物体を連続的あるいは間欠的に移動させながら前記膜状物体に加工を施し、次いで切断細条化して超伝導性のテープを作る方法、(3)前記した細長い平面形状を有する膜状物体を移動させる方法において、各位置における膜状物体の弛み量に応じて、駆動点毎に平均移動速度を加減する方法、(4)超伝導性酸化物の粉末を液体中で銀膜上に沈澱堆積させる時に、銀膜面に沿って液体を流し、粉末の形状異方性に従って整列堆積させる方法、(5)焼結用の高温炉内部での動力源として予熱したガスを用いる方法、などを考案した。

[作用] 板の曲げ強さ、換言すれば可撓性は板厚さが薄いほど良好となることは一般常識である。曲げ破壊は曲面の凸面上に発生し、その原因は引張り強さの不足にある。超伝導複合酸化物の典型であるYBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>はa-b面へき開により、c軸破断限界の歪み率が0.1%程度と言われている。

【0011】膜状構造の場合には鱗状小片が膜面と平行に配列されていると考えられるので、限界歪み率が1% 30程度、亀裂幅が1ミクロン程度と推測される。歪み率0.1%に相当する曲率半径と膜厚の関係は、

歪み率=0.5×(膜厚)/(半径)

より、膜厚が曲率半径の(1/500)となる。例えば、ボビン直径が10mmならば、膜厚は、10ミクロンが限界となる。

【0012】一部の研究者によると限界歪み率を1万分の1に押さえないと特性劣化を生ずると言われており、その場合の限界膜厚は1ミクロンとなる。このように、超伝導物質を薄膜化することにより可撓性を高めること 40ができる。

【0013】次に、膜状超伝導物質の面上に銀膜を形成した場合には、第1に、超伝導膜の亀裂あるいは超伝導性喪失に対する導電側路として動作することが確実といえる。その理由としては銀の密着性が良いために、a-b面に平行な非導電面の厚さが数Å存在してもトンネル効果により通電可能である他に、鱗状超伝導小片の側面に現れるa軸・b軸の如き導電軸に密接する可能性が大きいためである。第2に銀は酸素の透過率が高い他に、960度C以上の溶融状態において多量の酸素を吸収

し、冷却時に吸収酸素を放出する作用があるため、フラックスジャンプにより加熱されて超伝導性酸化物が放出した酸素を銀膜が一度吸収し、冷却時に銀膜が放出した酸素の一部または全部が酸素不足状態の超伝導性酸化物に再吸収されるために超伝導特性の劣化を軽減する作用がある。

4

【0014】以上により、第1目的ないし第3目的を達するための手段が有する作用について述べた。

【0015】第4目的を達するための手段が有する作用は、加工そのものは単純なプラスチック加工である。超伝導テープ面上への熱可塑性絶縁膜形成を共通工程において実施し、細条切り分け後に圧延拡幅あるいは流動拡幅により側端絶縁を形成させるため完成細条の幅を自由に設定できる。もちろん拡幅部の折り曲げ又は切断により、完成した超伝導テープの最大幅を所定値に整形することも可能である。

【0016】第5目的を達するための手段が有する作用は、(1)ベースフィルムの使用により、機械的に弱く破れやすい銀膜上の加工状況を安定化できる、(2)膜状物体に穴を開けて移動歯に係合させるような移動方式は、高温下での長い時間に及ぶ(例えば5時間ないし20時間の)低速移動を安定化できる他に、ペースト塗布あるいはメッキなどの不安定な膜形成操作時に膜面への接触を最小限にできるなどの良い効果がある、(3)膜状物体の移動時に膜の弛み量に応じて移動速度を調整することは、長時間の加工、特に常温より高温にいたる大幅な温度変化に伴って生じる寸法変化に起因する不安定性を吸収して加工工程の安定化をもたらす効果がある、

(4) 超伝導性酸化物に多い鱗状片,針状片などの形状 異方性と液体流動の相互作用により、各粉末片がテープ 面に沿って整列堆積する結果、引張り強さ・曲げ強さが 高められる、(5)高温炉内部の動力源として予熱され たガスを用いるため、高温状態にて電磁力装置を使う必 要がないほか、炉の内外を接続する機械動力系が不要で ある、動力用ガス導入による炉内雰囲気の擾乱を少なく する効果がある、などの好ましいものである。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施例を図によって説明する。

40 【0018】図1は本発明にかかる超伝導テープの断面図である。Aはもっとも簡単な構造の例であり、単層の酸化物超伝導膜10の上下両面に銀箔20,21を焼結し、この積層体40の上下両面に熱可塑性絶縁膜30,31が融着されると共に圧延拡幅されてテープの両側端に押し出された部分30B,31Bを内側に折り曲げて融着し、筒状絶縁構造を形成している。この際、積層体40と側端絶縁膜30B,31Bとの間に空隙32を生じる場合が多いが実用状の支障はない。Bは複数の酸化物超伝導膜を有する構造の例であり、2層の酸化物超伝50 導膜10,11はそれぞれの上下両面に銀箔20,21

5

及び22,23を焼結すると共に、中央部の銀箔21と 22をインジウムまたは低融点半田 (例えば金ビスマ ス,銀インジウムなど)50により融着して、これら一 体となった積層体の上下両面即ち銀箔20の上面および 銀箔23の下面に熱可塑性絶縁膜30,31を融着し、 Aの場合と同様に筒状絶縁構造を形成している。なお、 本例の場合には、熱可塑性絶縁膜30,31の軟化温度 が低融点半田50の軟化温度よりも高いことが望ましい が、インジュウム半田などの場合には、銀膜が半田層に 溶解する量を少なくするために、軟化温度の低い物質を 使うことが望ましい。又、Bに例示する多層構造体は、 銀箔を有しない純酸化物テープの積層にも適用でき、い ずれにしても、曲げ回数の少ない用途、例えば配線用に は図示の構造を有する完成した電線として供給し、使用 時に曲げ変形を与える場合には外部より加熱して低融点 半田50を融解した後に曲げることが望ましい。一方、 コイル巻線の如く曲げ回数の多い用途には、上側層と下 側層ならびに必要に応じて絶縁膜のない中間層を独立に 供給し、図7に示す如く巻線時に一体化治具を用いて、 積層加工・半田融着・側瑞絶縁加工を実施することが望 ましい。

【0019】図2は本発明にかかる超伝導テープの製作 法の1例を示す流れ図であって、図1Aに示す構造を形 成する過程の大要を示す。第1過程における銀箔の表面 酸化は陽極酸化法により施されて、後の加熱工程におけ る超伝導性酸化物の酸素不足を補う目的を有する。この 目的を達するため、高温酸化あるいは銀箔面に酸化銀の 粉末を塗布する方法を使ってもよい。第2過程は、ポリ スチレンを塗布したセルローズ・トリアセテート製ベー スフィルム上に第1過程を経た銀箔の1枚を融着あるい 30 は接着して銀箔の機械的強度を補う。ベースフィルムの 材質は分解除去・剥離が容易でメッキ液などの加工薬液 に犯され難い物質ならば何を使ってもよい。本例では塩 化メチレンなどの有機溶媒に溶解しやすく、寸法変化の 少ないセルローズ・トリアセテート膜に耐薬品性のよい ポリスチレンを塗布した例を示した。第3過程はベース フィルム上に形成された銀箔面上に超伝導性酸化物の原 料を塗布・加工して酸化物超伝導膜を形成する工程であ る。原料としては大別して2種ある。第1の場合は、Y Ba<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>粉末の如く所望の超伝導特性を有する粉 末をバインダと混練したペーストであり、バインダを揮 発あるいは燃焼揮発させるための低温熱処理により酸化 物超伝導膜を形成できる。第2の場合は、<従来の技術 >の項に記したY2O3, BaCO3, CuO混練物の如 く所望の超伝導特性を有しない物質ではあっても化学反 応あるいは溶解混合により超伝導性酸化物に変化する物 質であって、この場合には本過程の加工により得られる 膜が超伝導性を有しない例が多い。この第3過程を完了 して得られた中間生成物の構造を図3に示す。

【0020】図3のAは断面図、Bは上面図であって、

6 ベースフィルム1の両側瑞には係合穴2が側端に沿って 一定間隔毎に穴明けされており、この穴が駆動歯車の歯 に係合して移動させられるようになっている。ベースフ ィルム1の中央部上面には酸化銀膜21B, 21Aを有 する銀箔21、酸化銀膜21Aの上面に酸化物超伝導膜 10A(この過程では超伝導性を有しない場合もある) が形成されている。第4過程はベースフィルム1を除去 して第5過程に余分の物質を持ち込まないようにする工 程である。本例では表面のポリスチレンをベンゼンによ り溶解除去し、さらにコア材のセルローズ・トリアセテ ートを塩化メチレンにより溶解除去するのであるが、こ の処理済み溶解液の塩化メチレンを揮発濃縮してベース フィルム材として再生使用できる。揮発させた塩化メチ レンも冷却回収して再使用できる。この溶解を容易にす る方法としてベースフィルム中に分解エネルギーを生ず る微粒子を混合しておく手法がある。例えば炭素粉をベ ースフィルム中に分散させておいて、溶解時に赤外線を 照射することによりベースフィルムを加熱軟化させて溶 解を促進でき、あるいは磁性粉を分散させておけば磁力 により分解を促進できる、などの手法である。さらにベ ースフィルムの表面のみに分解性の強い物質を形成し て、その上に銀膜を形成し剥離性の強い構造とすること も考えられる。第5過程は高温加熱により焼結を行って 酸化物超伝導膜10Aを緻密化すると共に銀箔21との 接合を強める。なお酸化銀膜21A,21Bは分解し、 銀原子は銀箔21と一体化され、酸素原子は銀箔21と 酸化物超伝導膜10Aに吸収される他に一部がガスとし て放散される。第5過程の加熱雰囲気としては酸素が望 ましいが、大気で代用してもよい。酸化物超伝導膜10 Aは移動しつつ加熱されるが、移動に伴う温度変化の望 ましい状況は膜中に含まれる主要物質及びバインダなど の材質に依存するものである。通常は残留バインダを低 温にて揮発あるいは燃焼により除去した後、高温にて焼 結あるいは化学反応を促進する。第6過程では酸化物超 伝導膜10Aが焼結されて緻密な酸化物超伝導膜10に 変化した後、第2の表面酸化済み銀箔を密着させて酸素 雰囲気中で加熱焼結し、図1に示す積層体40を作る。 その後、酸素雰囲気中で徐冷することにより酸化物超伝 導膜10に酸素を吸収させて超伝導特性を向上させる。 超伝導酸化物としてYBa2Cu3O7を用いる場合、上 記の徐冷速度は600度Cより300度Cまで毎分2度 C以下とし、連続変化でもよいが、1段階20度C程度 の段階的変化でも差し支えない。第7過程では低温耐力 があり化学的にも安定な熱可塑性絶縁物であるポリ3弗 化塩化エチレン粒子を分散させた塗料を銀箔20の上面 と銀箔21の下面に塗布し、加熱流動化して熱可塑性絶 縁膜30,31を形成する。なおポリ3弗化塩化エチレ ンの加工可能な温度範囲が250度Cから260度Cと 狭いので、いわゆるFEP(4弗化エチレン・6弗化プ 50 ロピレン共重合体,加工温度範囲250度C~300度

C)を用いる場合もある。第8過程では第7過程にて形 成された絶縁積層体を所望の幅に切り分けて細条化す る。第9過程は、図4A(断面図)に示す細条を圧延す る工程であり、図4Bの如く加熱圧延台110と加熱圧 延板120により細条を加圧して熱可塑性絶縁膜30 A,31Aを圧延拡幅して側瑞押し出し部30B,31 Bを形成する。第10過程は側瑞部の絶縁被覆を完成さ せる工程であって、図4C,Dに示す如く第9過程にお いて圧延された細条を加熱金型210,220の台形引 き抜き穴211、逆台形引き抜き穴221に通して引き 10 テープの弛み具合を検出する弛みセンサーの断面構造を 抜き、最終的に図1 Aに示す超伝導テープを完成させ

【0021】図5は図2を修正した製作法の一部を示す 流れ図であって、図2に示す製作法において使われる第 1銀箔の代わりにベースフィルム1の片面にメッキ法に より形成した銀膜を使う方法を示しており、メッキ設備 の概要を図6に示す。

【0022】図6はメッキ装置の断面図であって、図に おいてベースフィルム1には図3に示されるような係合 穴2が明けられており、図6左下の拡大図に示されるよ 20 51を介して受けており、吊り下げスプリング154, うに係合穴2を歯車2Aに係合してベースフィルム1の 位置決め、あるいは歯車2Aを回転させてベースフィル ム1を移動させる目的に使う。このようにベースフィル ム1が所定の位置を所定の速度で移動しながら、まずイ オン交換機能を有するアルギン酸ナトリウム水溶液3を 塗布され、赤外線乾操灯4により乾燥されて、アルギン 酸ナトリウム膜3Aが形成され、つづいて硝酸銀水溶液 5に浸漬して銀イオンを吸収させた後、水洗して乾燥灯 6により乾燥してアルギン酸銀膜5Aを形成し、紫外線 灯7(波長は約250mm)に曝らして薄い銀膜5Bを 30 に液体を吹き付けるとよい。また、検出光と外部光を区 析出形成し、これを陰極板として第1メッキ槽8におい て大電流密度の電解銀メッキを施して密に分散展開した 微小メッキ核を形成した後、小電流密度の電解銀メッキ 槽9にて所望の厚さを有する緻密なメッキ銀膜5Cを形 成する。このようなメッキ工程においては、ベースフィ ルム1の弛み具合を調節する必要があり、駆動歯車2 A, 2B, 2C, 8A, 8C, 9A, 9Bは各々が独立 に駆動され、各々の回転速度は各々の近辺におけるベー スフィルム1の弛み具合に応じて調節される。このよう 程の銀面陽極酸化を施し、第3過程以後は図2の第4過 程以後と同様な操作を施す。なお図5第1過程の銀メッ キとして10ミクロン以上の厚さを有し、若干の粗雑さ を許容するならば無電解銀メッキ法を用いることにより 工程を簡素化できる他、真空蒸着法でもよい。

【0023】図7は、図1Bに関連して述べた如く、多 層構造テープの形成法を説明する概略図であり、上面に 熱可塑性絶縁膜を有する超伝導テープ510、上面に低 融点半田を塗布した超伝導テープであって絶縁膜を有し 田を塗布するとともに下面に熱可塑性絶縁膜を有する超 伝導テープ530の3層を積層して、一体化冶具550 により絶縁テープ電線を作り、コイル状に巻線する方法 を示す。中間層を2層以上重ねてもよく、側端絶縁が不 完全であっても巻線後にコイル全体に絶縁物を含浸する ことにより絶縁性を維持できる。

8

【0024】図8は弛みセンサーの断面図であり、図6 に例示した如く係合穴と歯車を組み合わせてテープ状物 体を移動させる場合に、歯車の回転速度を調節するため 示す。図において、センサーは、壁150、弛みを検出 すべきテープ151、テープ下面に接する接触子15 2、接触子より垂下する遮光板153、接触子を吊り下 げるスプリング154,155,弛ませるためにテープ の上面に吹き降ろす気流156、側壁に取りつけられた 透光板157,158、発光源160、投光レンズ16 1、検出用光線162、受光レンズ163、光量検出用 フォト・トランジスタ164を要素として組み立てられ ている。接触子152は、気流156の圧力をテープ1 155の吊り上げ力、テープ張力のバランスする位置に 浮かんでいて、テープ張力が弱く弛みの多い場合には下 方へ、張力が強く弛みの少ない場合には上方へ移動す る。このため、弛みの多少がフォト・トランジスタへの 入射光量の少多となるので、弛み量を検出できる。検出 を半ディジタル化して、隣り合った2個のフォト・トラ ンジスタをつかって受光し、2個とも暗ならば弛み過大 ・2個とも明ならば弛み不足としても良い。なお、液体 中の弛み具合を検出するためには、気流156の替わり 別するために光源をパルス状にしても良い。 【0025】図9は、図2あるいは図5の流れ図をさら

に変形した超伝導テープ製造過程を示す流れ図である。 まずベースフィルム製造装置より始まって各種処理装置 を経て細条化され単層絶縁テープとなりコイルに巻かれ るまでの各装置及び各加工ステップにおけるフィルムの 形状を示している。本例では、超伝導酸化物膜に焼結処 理による亀裂があっても、後段の酸化銀粉堆積焼結処理 によって亀裂を埋めることが可能であり、微少な亀裂に にして図5に示される第1過程を終了し、続いて第2過 40 対しては硝酸銀のアルコール溶液を塗布・加熱分解して 埋め込む方法がある。もしも、亀裂の心配がなければ、 酸化銀粉堆積工程を超伝導性材料堆積工程の次に移して 酸化銀粉焼結工程を削除してもよい。また銀面酸化工程 を削除することも可能である。このほか本例では、側瑞 穴明け工程が銀メッキ直前に1工程のみであるが、焼結 加工を安定化するために超伝導性材料堆積直後に1工程 追加して、係合穴を多くすることも考えられる。

【0026】図10は、図9におけるベースフィルムの 製造から銀メッキまでの状況を示す装置断面図である。 ない中間層520(複数枚でもよい)、上面に低融点半 50 装置の主要部は、ベースフィルム製造装置170、その

構成要素であるフィルム原液槽171、塩化メチレン9

20

0 容とエタノール 1 0 容の混合溶媒にセルローズ・トリ アセテートを溶解したフィルム原液172、フィルム原 液を塗布乾燥してフィルムにするための乾燥ローラ17 3、ベースフィルム製造装置より出てきたベースフィル ム174、側瑞穴明け及びポリスチレン塗布を行う装置 175、銀メッキのための塩化錫系前処理液176、前 処理液の循環ポンプ178、ベースフィルムに対して循 環ポンプ出口より吹き付けられる前処理液179、洗浄 銀水溶液182、硝酸銀水溶液の循環ポンプ183、ベ ースフィルムに対して循環ポンプ出口より吹き付けられ る硝酸銀水溶液、銀のアンモニア錯塩を形成するための アンモニアガス発生用アンモニア系物質(例えばアンモ ニア水) 184、銀を還元析出させるための還元性ガス 発生物質(例えばホルマリン水)185、ガス排出用圧 縮空気配管186、排気ダクト187,188、フィル ム送り出し用駆動歯車189、銀メッキ済み(先浄前) ベースフィルム190ならびに多くの案内ローラ(○ 印)であって、フィルムあるいは液などの移動方向は→ 印により示している。なお、フィルムの弛み具合を調節 する必要があるならば、案内ローラの一部を駆動歯車に 替えて弛みセンサー(図8)と組み合わせて使えはよ い。この図10では、塩化錫系前処理装置とヒータ18 1による乾燥装置と硝酸銀水溶液吹き付け装置とアンモ ニア・ホルマリン処理装置を別々に配置しているが、こ れらの装置を1列に並べて薬液吹き付け部分をテープの 下側に統一した方が、処理の安定性を増す。特に硝酸銀 水溶液吹き付け処理からアンモニア処理までの間の水分 蒸発を防げること、また案内ロールの数を減少出来るこ とは有益である。しかし、硝酸節水溶液吹き付け装置に アンモニアが混入しないように注意する必要がある。こ のような装置により形成された銀膜の平坦度、緻密度に 満足できない場合には、交流パルス法による電解メッキ を併用すればよい。

【0027】図11は、均一な薄さの超伝導膜を形成す るために粉末状材料をテープ上に堆積する方法を示す装 置断面図である。ここに例示する方法は、液体中に分散 させた微粉末を沈澱沪過法により選別して望ましい粒子 のみをテープ上に堆積させる。装置の主要部は、沈澱槽 250、第1隔壁251、第2隔壁252、第3隔壁2 53、第4隔壁254、第1隔壁に造られた貫通穴25 5、液体循環用吸い出し管256、循環ポンプ257、 循環用戻し管258、攪拌機259、粉末材料ストッカ 260、粉末材料261、第1槽内沈澱物262、第2 槽内沈澱物263、第3槽内沈澱物264、第4槽内沈 澱物265、第1槽のエタノール271、第2槽のエタ ノール272、第3槽のエタノール273、第4槽のエ タノール274、第5槽のエタノール275、テープ案

10

出し用駆動歯車283、テープの部分であるベースフィ ルム285、銀膜286、第4槽内にて銀膜上に堆積し た粉末材料287、駆動歯車283の回転を調節するた めに使われる弛みセンサー288 (図8) である。操業 中に各槽の底に沈澱堆積した粉末材料は適宜除去される と共に、蒸発等により減少したエタノールは第1槽に補 充されて、順次、第1槽より第5槽へと流れてゆく。さ らに、エタノール中の粉末分散状況を調べるために光を 投射して透過率あるいは反射率を調べ、粉末濃度を判定 用配水管180、乾燥用ヒータ181、銀メッキ用硝酸 10 して粉末投入量を調節することも可能である。このよう を方法は図9に示す酸化銀粉堆積のためにも使用でき る。第4槽内の案内ロール281,282の軸受けには 沈澱物質が侵入し易いので、侵入を防ぐために、図12 に示す如く軸受け部を保護箱にて覆い、固形物を含まな いアルコールを保護箱に圧入することが望ましい。駆動 歯車がある場合は、保護箱内の駆動軸を水車構造として 圧入アルコールにより駆動するとよい。このほか、堆積 すべき粉末の形状が鱗片状、針状の場合には、引張り強 さを高めるために各片をテープ面と平行に配列堆積する ことが望ましい。このために図13のようにテープ面上 にアルコールを流し、流体圧力を利用して各片を整列さ せる方法が考えられる。

> 【0028】図12は、図11に例示したように堆積槽 内部で使われる軸受けの断面を示し、この軸受けの構造 は、軸350を支承する軸受け箱351に内部空洞35 2と圧力液354を注入する注入口353を形成し、軸 350の長手方向漂動を防止する支承ボール355、封 止ネジ356より構成されている。

【0029】図13は粉末堆積法の1実施例であって、 30 舛鱗状片,針状片を整列堆積する方法を示す装置断面図 であって、堆積槽363の内部を傾斜して走行するテー プ360上に粉末分散液362を流下させるための中継 槽361より構成されている。

【0030】図14は焼結炉の断面を示し、焼結すべき テープ310、加熱機能を有する炉体311、導入歯車 312、調速歯車313、圧延ロール314、ロール駆 動用風車315、弾性支持体321、予熱ヒレ319を 有する酸素供給パイプ316より吹き出す風車駆動用酸 素気流317、酸素供給量調節弁320、酸素供給配管 40 336、供給酸素337、予熱ヒレ323を有する酸素 供給管322より吹き出す酸素気流324により形成さ れるテープの弛み部分325、鏡326,327とパル ス光源331と投光レンズ332と光線328,32 9,330と受光レンズ333とフォト・トランジスタ 334より構成される弛み検出機構、ピンチ・ロール3 18、テープ送り出し歯車334、焼結済みテープ33 5より構成されていて、炉内の機構部品は主に窒化珪素 あるいは酸化窒化珪素から造られ、弾性材はイットリウ ム安定化酸化ジルコニウム製であって、調節弁320は 内用自由回転歯車280,281,282、テープ送り 50 弛み検出機構の出力信号によって適当なテープ弛みを形

成するよう調節される。もちろん、調速歯車313と送 り出し歯車334は各々の近くでのテープ弛みを検出し て速度調節されることが望ましい。また、弾性支持体3 21は圧延圧力の安定化を目的とするものであり、不安 定な前後左右振動などを生じないように注意する必要が ある。さらに、パルス光源331は水銀灯など短波長光 源(青色光,紫外線など)を用いて、背景雑音となる炉 内の熱放射光に対するS/N比を高めるなどの注意が必 要である。

#### [0031]

【発明の効果】本発明によれば、酸化物超伝導物質のよ うに堅くて脆い材料を用いても、可撓性の高いテープ状 線材を得ることが可能であり、超伝導性喪失に対する導 電側路と隣接線との絶縁性も保証され、原理上は無限に 長い線材を得ることも可能である。

【0032】さらに、ベロブスカイト型超伝導物質の有 する異方性を利用して可撓性を一層高めることもできる 他、導電特性も改善できる見込みがある、など電磁石用 巻線材として好ましい効果がある。

[0033]

【図面の簡単な説明】

【図1A】本発明の1実施例である単層超伝導テープの 横断面を示す断面図である。

【図18】本発明の別の実施例である2層超伝導テープ の横断面を示す断面図である。

【図2】本発明の1実施例である単層超伝導テープの1 製作法を示す流れ図である。

【図3A】図2に示す製作法による中間生成テープの横 断面を示す断面図である。

【図3B】図3Aに示す中間生成テープの一部を示す平 30 210~221 絶縁膜整形用加熱金型 面図である。

【図4】AからDまで、本発明の熱可塑性絶縁膜整形過 程を示す断面図である。

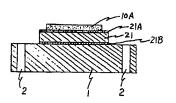
【図5】銀メッキを応用して、本発明の1実施例である 超伝導テープを製作する過程の一部を示す流れ図であ

【図6】本発明の1実施例である銀メッキ装置の概略を 示す断面図である。

【図7】本発明の1実施例である3層超伝導テープを形 成する方法を示す概略図である。

【図8】弛みセンサーの断面図である。

【図3A】



【図9】本発明の1実施例について、ベースフィルム形 成から完成超伝導テープ巻取りまでの全過程を示す流れ 図である。

12

【図10】ベースフィルム形成から銀メッキまでの処理 を行う装置の断面図である。

【図11】粉末堆積装置の断面図である。

【図12】粉末堆積装置内部で使用する軸受け装置の断 面図である。

【図13】粉末堆積時に、粉末の形状異方性に従って整 10 列堆積させる装置の断面図である。

【図14】焼結炉の断面図である。

【符号の説明】

1 ベースフィルム

2 係合穴

2A 駆動歯車

3 アルギン酸ナトリウム水溶液

5 硝酸銀水溶液

5C 電解メッキ銀膜

8~9 電解メッキ槽

20 10,11, 酸化物超伝導膜

20~23 銀箔

30,31 熱可塑性絶縁膜

40 銀箔と酸化物超伝導膜の積層体

110 加熱圧延台

120 加熱圧延板

130 圧延用圧力

152~164 弛みセンサー部

170~175 ベースフィルム形成部

176~189 無電解銀メッキ装置

250~288 粉末堆積装置

311~337 焼結炉

351~356 粉末堆積装置用軸受け

361~364 整列堆積装置

510~530 積層用超伝導テープ

540 積層された超伝導テープ

550 積層用一体化治具

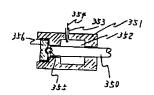
174, 190, 285~287, 360, 310, 3

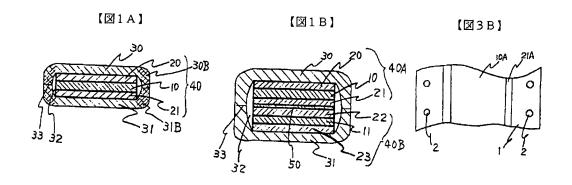
35 中間形態のテープ

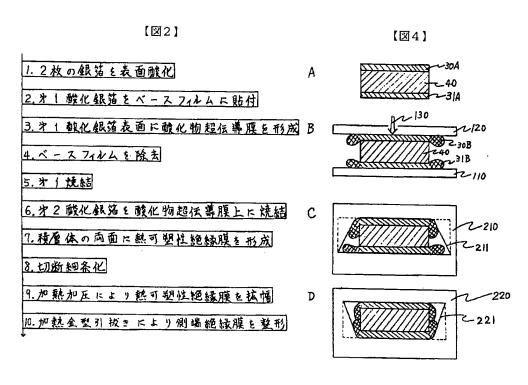
40 〇印 案内ロール

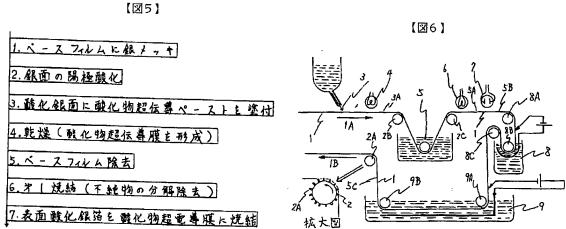
→印 走行方向,回転方向

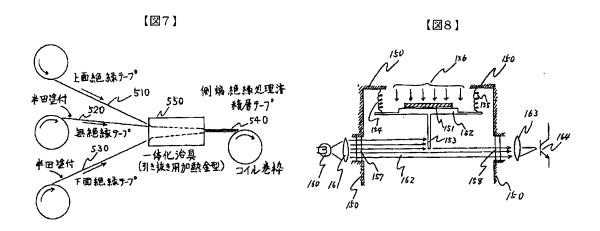
【図12】



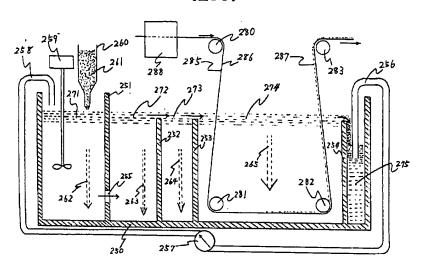




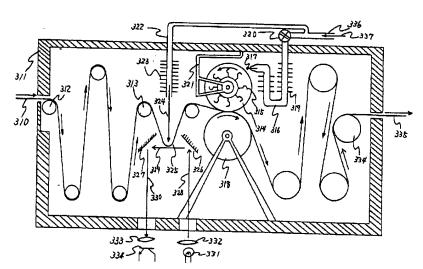


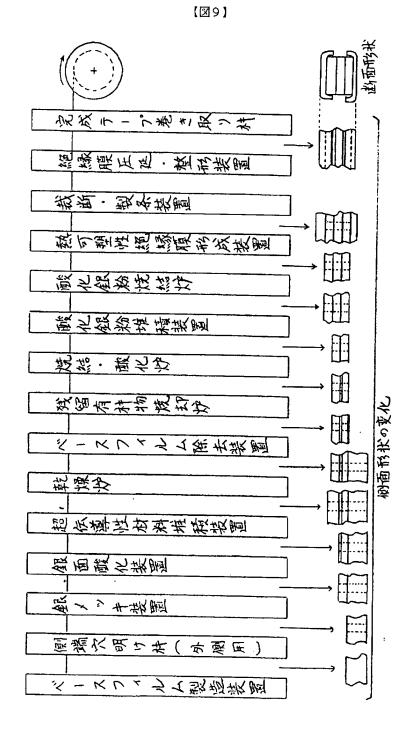


【図11】



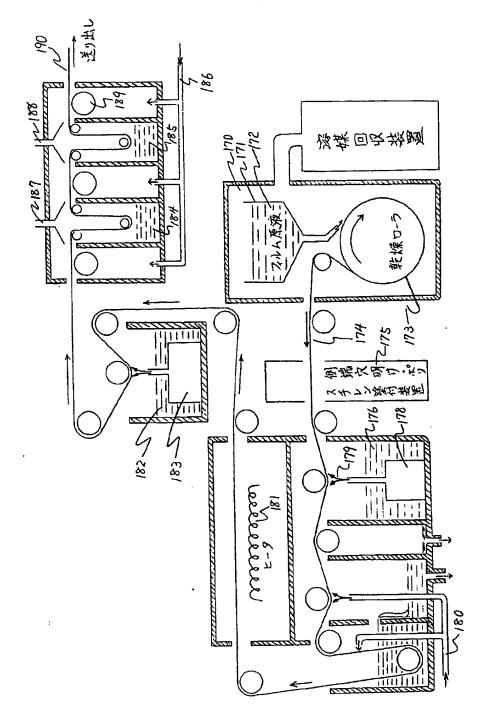
【図14】





WEST

# 【図10】



【図13】

